# METHOD OF PRODUCING ETCHED METAL FOIL-BONDED LAMINATED BOARD

Patent number:

JP59084491

Publication date:

1984-05-16

Inventor:

KATOU KAZUO; NAKANO TATSUO; ASAI

SHINICHIROU

Applicant:

DENKI KAGAKU KOGYO KK

Classification:

- international:

B32B15/08; H05K3/06

- european:

C23F1/18

Application number: JP19820193417 19821105 Priority number(s): JP19820193417 19821105

Report a data error here

Abstract not available for JP59084491

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—84491

Int. Cl.<sup>3</sup>
H 05 K 3/06
B 32 B 15/08

識別記号

庁内整理番号 6465--5F 2121--4F 砂公開 昭和59年(1984)5月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❸エツチングした金属箔張り積層基板の製造方法

②特 願 昭57-193417

②出 願 昭57(1982)11月5日

@発 明 者 加藤和男

町田市旭町3-5-1電気化学 工業株式会社中央研究所内

@発 明 者 中野辰夫

町田市旭町3-5-1電気化学 工業株式会社中央研究所内

⑫発 明 者 浅井新一郎

町田市旭町3-5-1電気化学 工業株式会社中央研究所内

⑪出 願 人 電気化学工業株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目4

番1号

#### 明 細 物

### 1. 発明の名称

エッチングした金属箱張り積層基板の製造方法 2.特許請求の範囲

絶縁物層上にアルミニウムー銅重ね合せ箔を積層した積層基板において、前記アルミニウムー銅重ね合せ箔の銅箔部分をパターンエッチングするに際し、硫酸及び過酸化水素を主成分とするエッチング剤を使用することを特徴とするエッチングした金씷箔張り積層基板の製造方法。

#### 3.発明の詳細な説明

本発明は、アルミニウムー鋼重ね合せ箔張り基板の選択銅エッチングするエッチングした金属箔 張り積層基板の製造方法に関する。

従来、温成集積回路においては、アルミニウム 線もしくは金線による半導体と回路との結線及び 回路と外部リード線、半導体およびその他の回路 素子との固着を半田付により行つていた。従つて との用途の基板においては、半田付部分には銅回 路が必要であり、アルミニウム線等のワイヤポン デイング部分には、貴金属メッキ、ニッケルメッキ等を必要とした。

これら、この両方の配線を容易に行なえる様にした基板には、アルミニウムおよび銅の両方の金属が露出した回路基板がある。 すなわち、アルミニウム部分にアルミニウム線もしくは金線による配線を行ない、 網部分に半田付による配線を行なり ものである。

点があつた。

本発明におけるアルミニウムー網重ね合せ箱とは、アルミニウムと網とが電気的に導通した 貫層箱を貫い、具体的には、アルミニウムと網とのクラッド箔、アルミニウム箱上に鍋メッキした箱、或はアルミニウム箱に亜鉛、鍋を順次メッキしたもの等である。アルミニウム層及び銅磨の夫々の

ることを言う。

本発明における硫酸および過酸化水素を主成分とするエッチンが削におけるエッチンが削におけるエッチンがは次の化学式に従つて進行する。

 $0u + H_30_2 + H_280_4 \rightarrow Cu80_4 + 2 H_20$ 

従つて銅を硫酸銅の結晶としてエッチング削から除き、消費された硫酸の結晶とび過少が条件でまるである。またこの硫酸 である。またこの硫酸 なの結晶化はエッチング液を冷却することにより容易に行なえるため除去しやすく、過硫化アンモニアと銅の様にアンモニアと銅イオンが強なっくり、鋼イオンが除去しにくいという欠点もない。

本発明における硫酸~過酸化水素系エッチング 剤には、これらの主成分の他にエッチング促進剤 や過酸化水素を安定化させる添加剤等を添加して もよい。

以下、実施例および比較例により本発明を更に説明する。

厚さは特化限定しないが、 0.1 μ ~ 2 0 0 μ が好ましい。

本発明における絶縁層には通常の銅張り積層基板に用いられている紙フェノール、ガラスエポキン等の積層体、ポリイミドフイルムの様をフィルム、金属板上にエポキン樹脂、シリコン樹脂、ポリイミド樹脂、およびそれらと無機フィラーの複合材を積層し、絶縁をとつたものがある。

#### 奥施例1

厚さ 1.6 幅のガラスエポキシ積 暦体にアルミニ ウム層の厚さが15μ、銅層の厚さが35μのア ルミニウムー鋼クラッド箱を銅面を上にして張り 合せた。この基板の銅面にエッチングレジスト DA - 200B (サンワ化学機商品名)をスクリ ーン印刷により盗布し、80℃、10分間乾燥し た。その後、銅の選択エッチング剤である硫酸を 20容量を及びパーマエッチ(荏原電産物商品名、 過酸化水素を50容量の含有する)を10容量の 混合したエツチング液で54℃、2分間スプレー エッチングした。その結果、下層のアルミニウム 層はエッチングされずに、レジストを盤布してい ない銅部分のみがエッチングされ、アルミニウム、 層の露出した基板が得られた。次にこの基板を苛 性ソーダ2g水溶液で洗浄しエッチングレジスト を除去した。この結果、アルミニウム箔上に銅回 路が形成された基板が出来た。

この基板は、更にアルミニウムを選択エッチン がすることにより倒とアルミニウムの両方が露出

### 特別昭59-84491(3)

した芸板となる。

#### 実施例2

ラムダイト(電気化学工業機のの厚地では、 カリエポルのでは、100 μに、15 mm 板上に、100 μに、100 με 100 με

次にこの基板に実施例1と同じレジストをスクリーン印刷し、実施例1と同じ銅選択エッチング条件でエッチングした。その後、トルエンでレジストを剝離し、銅回路とアルミニウム回路の両方

が露出した薪板を得た。アルミニウム回路はとの 銅選択エッチングでエッチングされなかつた。 比較例 1

実施例1と同じレジスト付基板を塩化第2鉄の30重量気水溶液を40℃でスプレーエッチングした。その結果下層のアルミニウム層までエッチングされ、銅のみの選択エッチングはできなかつた。

#### 比較例 2

通硫酸アンモニウム2509ノ 4 水溶液、銅濃度359ノ 4 の条件下で実施例 1 と同じレジスト付基板を40℃で15分間スプレーエッチングした。 アルミニウム層はエッチングされなかつたが 鋼が完全にエッチングされず、 斑点状に銅が残った。

以上述べたように本発明による硫酸-過酸化水素を主成分とするエッチング剤を使用することにより、アルミニウムと銅の重ね合せ箔を張つた蒸板の銅過択エッチングが可能であつた。

特許出願人 電気化学工業株式会社